



装置性能

- ▶ この装置の主な用途は単結晶材料の表面欠陥を測定する半自動測定装置です。SCM システムで収集したデータはコンピュータの分析システムでデータを処理してピクの角と（FWHM）値を得る。これで結晶表面の成長性の完備性を判断する。
- ▶ 本装置はウエハーの測定も出来る、インゴットの測定も出来る。
- ▶ 各種類単結晶材料の角度値を測定出来る
- ▶ 一回測定時間は 18"（スキャン角度範囲 $\pm 5'$ ）、一回或いは繰り返し測定可、反復性 $\leq \pm 2''$ （サファイア研磨チップで測定）。

精度

- ▶ サファイア研磨チップで測定、精度は $\pm 5''$ 、最小示度は $1''$ （装置表示：度分秒）